

高分子加工技術研究会 第 63 回例会の参加募集

主 催：日本レオロジー学会 高分子加工技術研究会

日 時：2007 年 3 月 9 日（金）13：30～16：45

場 所：東京工業大学百年記念館 3F フェライト会議室

〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1

（交通）東急目黒線・大井町線 大岡山駅下車徒歩 1 分

東京工業大学大岡山キャンパス・正門わき

（問合せ先：百年記念館 2 階事務室 Tel 03-5734-3340）

主 題：接着と高分子

プログラム：

1. 「高分子成形体の表面構造・物性の調べ方と接着」

神戸大学 西野 孝 氏

2. 「機能性接着剤とその性能」

セメダイン（株） 永田宏二 氏

3. 「電子材料用シリコン系接着剤の最新動向」

東レ・ダウコーニング（株） 中田稔樹 氏

参加費：2,000 円。高分子加工技術研究会の会員及び学生は無料。

（高分子加工技術研究会の年会費は 3,000 円です。

この機会にご入会をお勧めします。）

連絡先：〒162-0826 東京都新宿区市ヶ谷船河原町 12-1

東京理科大学 理学部 応用化学科 澤井大輔

E-mail: dsawai@ch.kagu.tus.ac.jp

TEL 03-3260-4272(ext.5769), FAX 03-3235-2214